

平成29年度 Nanotech CUPAL NIMS N.I.P.コース募集スケジュール

アライアンス内育成対象者として受講する方は申請書をご提出ください。

H29.8.8

コース番号	コース名	募集人数	実施期間	申請書提出期限
—	先端計測技術入門コース (TEM)			
FY2017_NI001_A	FIBによる断面試料作製	10	5月10日～12日	受付終了
FY2017_NI001_B	イオンミリングによる断面試料作製	10	7月19日～21日	受付終了
FY2017_NI001_C	TEM操作の基本	10	10月25日～27日	9月30日
FY2017_NI001_D	TEM/STEM・EELSの基礎	10	1月24日～26日	12月22日
—	先端計測技術上級コース (TEM)	計6	各コース共通 (下記期間のうち延べ10日間程度)	
FY2017_NI002_A	TEM/STEM観察・分析技術	通年2	5月8日～7月28日	受付終了
FY2017_NI002_B	収差補正TEM/STEM技術	通年2	8月1日～10月31日	受付終了
FY2017_NI002_C	STEM-EDS/EELS分析技術	通年2	11月1日～1月31日	受付終了
—	先端計測技術入門コース (表面解析)	計36	各コース共通 (4回/年)	
FY2017_NI003_A	超高真空走査型トンネル顕微鏡の初歩	各回3	5月23日～25日	受付終了
FY2017_NI003_B	表面分析の初歩	各回3	8月1日～3日	受付終了
FY2017_NI003_C	走査型ヘリウムイオン顕微鏡の初歩	各回3	11月14日～16日	10月31日
			2月20日～22日	1月10日
—	先端計測技術上級コース (表面解析)	計6	各コース共通 (下記期間のうち延べ10日間程度)	
FY2017_NI004_A	極高真空低温SPM法	通年2	4月3日～7月28日	受付終了
FY2017_NI004_B	表面解析PEEM/MEEM法	通年2	7月31日～12月1日	8月31日
FY2017_NI004_C	Heイオン顕微鏡	通年2	12月4日～3月30日※	12月22日
—	先端計測技術入門コース (構造解析)	計60	各コース共通 (4回/年)	
FY2017_NI005_A	X線・中性子粉末構造解析法の初歩	各回6	6月20日～22日	受付終了
FY2017_NI005_B	小角X線散乱計測法の初歩	各回3	8月29日～31日	受付終了
FY2017_NI005_C	X線反射率法の初歩	各回3	12月19日～21日	12月1日
FY2017_NI005_D	核磁気共鳴実験の初歩	各回3	3月13日～15日	1月10日
—	先端計測技術上級コース (構造解析)	計8	各コース共通 (下記期間のうち延べ10日間程度)	
FY2017_NI006_A	粉末回折法	通年2	4月3日～7月28日	受付終了
FY2017_NI006_B	小角/極小角X線散乱法	通年2	7月31日～12月1日	8月31日
FY2017_NI006_C	薄膜・多層膜X線反射率法	通年2	12月4日～3月30日	12月22日
FY2017_NI006_D	固体NMR計測法	通年2		

※先端計測技術上級コース (表面解析) のサブコース[表面解析PEEM/MEEM法]は12月4日～3月30日の期間は実施しません。

申し込み・問合せ : NIMS nanotech_cupal@nims.go.jp

アライアンス構成機関

産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構、筑波大学、京都大学、北海道大学、東京大学、東京工業大学、東京理科大学、早稲田大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、立命館大学及び同志社大学

アライアンス内育成対象者の応募要件

アライアンス構成機関に所属する博士号取得後10年以内または同等程度の研究経歴を有する若手研究者、博士課程 (後